

528 Rec'd PCT/PTO 18 JUL 2000  
PATENT

**CERTIFICATE OF MAILING**

I hereby certify that on July 13, 2000, this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

37 C.F.R. § 1.8(a) ☒ with sufficient postage as first class mail  
37 C.F.R. § 1.10 ☐ as "Express Mail Post Office to Addressee" Mailing Label No.

*Josephine K. Purks*  
Josephine K. Purks

Applicant: **Inoue et al.** ✓  
Serial No.: **09/578,998** ✓  
Filed: **05/25/00** ✓  
Title: **MULTI-COMPONENT GAS ANALYZING METHOD USING FTIR** ✓

Group Art Unit: **unassigned**  
Examiner: **unassigned** ✓  
Atty Docket No.: **380153-62** ✓

*S. Coe*  
*10-12-00*  
*#5 priority papers*

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPY**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, DC 20231

Sir:

Attached please find the certified copies of the foreign applications from which priority is claimed for this case.

Country: Japan  
Application Number: 11-158493 ✓  
Filing Date: June 4, 1999 ✓

Respectfully submitted,

*Ronald S. Tamura* ✓  
Ronald S. Tamura  
Registration No. 43,179

Date: July 13, 2000

**OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP**  
2029 Century Park East, 38th Floor  
Los Angeles, CA 90067-3024  
(949) 719-6000  
(949) 719-6040

RECEIVED  
JUL 13 2000  
TECHNICAL ROOM



## 日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 6月 4日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第158493号

出 願 人

Applicant (s):

株式会社堀場製作所



TO CLERK'S ROOM

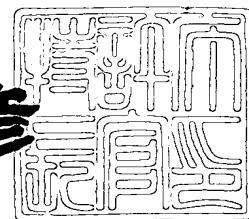
JUL 18 2000

RECEIVED

2000年 5月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3036352

【書類名】 特許願

【整理番号】 162X021

【あて先】 特許庁長官殿

【発明者】

    【住所又は居所】 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場  
                          製作所内

    【氏名】 井上 香

【発明者】

    【住所又は居所】 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場  
                          製作所内

    【氏名】 足立 正之

【特許出願人】

    【識別番号】 000155023

    【氏名又は名称】 株式会社堀場製作所

【代理人】

    【識別番号】 100074273

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 藤本 英夫

    【電話番号】 06-6352-5169

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 017798

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 9706521

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 F T I R 法による多成分ガス分析方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 F T I R 法で得られた吸収スペクトルに基づいて試料中の複数成分を定量分析する F T I R 法による多成分ガス分析方法において、定量アルゴリズムによって混合ガススペクトルから多成分濃度を算出した後、一部の成分についてはさらに共存ガス成分によるスペクトルの変化分の補正計算を行うようにしたことを特徴とする F T I R 法による多成分ガス分析方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

この発明は、F T I R（フーリエ変換赤外分光）法で得られた吸収スペクトルに基づいて試料中の複数成分を定量分析する F T I R 法による多成分ガス分析方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

図 1 は、上記 F T I R 法に則ったフーリエ変換赤外分光光度計を用いたガス分析装置（以下、F T I R ガス分析装置という）の構成を概略的に示すもので、この図において、1 は分析部、2 はこの分析部 1 の出力であるインターフェログラムを処理するデータ処理部である。

【 0 0 0 3 】

前記分析部 1 は、平行な赤外光を発するように構成された赤外光源 3 と、ビームスプリッタ 4、固定ミラー 5、図外の駆動機構によって例えば X-Y 方向に平行移動する可動ミラー 6 からなる干渉機構 7 と、測定試料や比較（参照）試料等を収容し、干渉機構 7 を介して赤外光源 3 からの赤外光が照射されるセル 8 と、半導体検出器 9 等から構成されている。

【 0 0 0 4 】

そして、前記データ処理部 2 は、例えばコンピュータよりなり、インターフェログラムを加算平均し、その加算平均出力を高速でフーリエ変換し、さらに、こ

のフーリエ変換出力に基づいて測定対象成分に関するスペクトル演算を行うように構成されている。

【0 0 0 5】

上述のように構成された F T I R ガス分析装置においては、次のようにして複数の成分を定量分析することができる。すなわち、セル 8 に比較試料または測定試料をそれぞれ収容して赤外光源 3 からの赤外光をセル 8 に照射し、比較試料または測定試料のインターフェログラムを測定する。これらのインターフェログラムをデータ処理部 2 において、それぞれフーリエ変換してパワースペクトルを得た後、比較試料のパワースペクトルに対する測定試料のパワースペクトルの比を求め、これを吸光度スケールに変換することにより吸収スペクトルを得た後、この吸収スペクトル中の複数の波数ポイントにおける吸光度に基づいて測定試料中に含まれる複数の成分を定量分析するのである。

【0 0 0 6】

上記複数の成分を定量分析する方法として、例えば、本願の出願人に係る特許第 2 6 4 9 6 6 7 号、特許第 2 7 4 1 3 7 6 号、特許第 2 9 2 6 2 7 7 号、特許第 2 9 2 6 2 7 8 号の明細書に記載されたものがあり、例えば特許第 2 6 4 9 6 6 7 号の多成分分析方法は、吸収スペクトル中の複数の波数ポイントにおける局所的ピーク値と局所的バレー値との差である相対吸光度の和を求め、この和に基づいて複数の成分の濃度を各別に得るというものである。

【0 0 0 7】

さらに、多成分の定量分析に際しては、上記方法のほか、PLS (Partial Least Square、部分最小二乗) 法、PCR (Principal Component Regression、主成分分析) 法等といった多変量解析の定量アルゴリズムを用いることもできる。これらの方法はいずれも、濃度既知の参照スペクトルに基づいて予め濃度演算用のデータ (校正行列) を作成しておき、濃度未知の試料のスペクトルデータとの演算行列により、複数の成分の濃度を各別に算出するものである。

【0 0 0 8】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記 F T I R 法によるエンジン排ガス測定では、前記 P L S 法、P C R 法等、一般に用いられる定量アルゴリズムを適用するだけでは、実サンプルガス測定時において、C O、C O<sub>2</sub>、N O の指示がサンプルガス中に共存する高濃度の H<sub>2</sub> O の影響を受けて実際の濃度より高くなることがわかっている。これは、前記定量アルゴリズムでスペクトルの重なりが分離しきれないことによる干渉とは異なり、同一成分・同一濃度であってもベースガス組成により、例えば、図 6 に示すように、スペクトル強度に差が生ずるためである。より具体的には、(N<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> O) ガススペースの実サンプル中の C O のスペクトルの方が、N<sub>2</sub> ガススペースのスパングス中の C O のスペクトルより吸収が大きいためである。なお、図 6 において、符号 1 0, 1 1, 1 2 は、N<sub>2</sub> をベースガスとしたときの C O、C O + H<sub>2</sub> O、H<sub>2</sub> O のそれぞれ吸収スペクトルを示している。なお、これと同様の現象は、赤外線吸収のない O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub> の共存によっても起こりうる。

## 【 0 0 0 9 】

上述のような現象が生ずる正確な機構は不明であるが、一つには、ガス分子同士の相互作用によるクエンチング等が関係している考えられる。図 7 は、クエンチングによる赤外吸収量変化モデルを示すもので、このモデルは、ガス成分 X とベースガスの衝突確率および相互作用の大小によって、赤外吸収量に変化が生ずることを示している。すなわち、同図 (A) は、ガス成分 X に対してベースガス A の衝突確率および相互作用が共に小さい場合を示し、この場合、ガス成分 X の基底状態・励起状態の平衡に影響を余り与えないため、ベースガス A の存在はガス成分 X の吸収量に殆ど影響しない。また、同図 (B) は、ガス成分 X に対してベースガス B の衝突確率および相互作用が共に大きい場合を示し、この場合、ガス成分 X の平衡が基底状態側にずれるため、新たな光吸収が起こりやすくなる。つまり、ベースガス B の存在により、ガス成分 X の吸収強度が大きくなり、ベースガスが成分 A であった場合よりも強い吸収を示す。図 6 に示した例では、N<sub>2</sub> が成分 A、H<sub>2</sub> O が成分 B、C O が成分 X に相当する。

## 【 0 0 1 0 】

また、他の機構としては、他成分の共存によって吸収スペクトルの線幅が広がる「衝突広がり」というメカニズムも考えられる。

【0 0 1 1】

この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、ベースガス組成によるスペクトル自体の強度変化に起因する共存ガスの影響を補正し、精度の高い測定を行うことができる F T I R 法による多成分ガス分析方法を提供することである。

【0 0 1 2】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、この発明では、F T I R 法で得られた吸収スペクトルに基づいて試料中の複数成分を定量分析する F T I R 法による多成分ガス分析方法において、定量アルゴリズムによって混合ガススペクトルから多成分濃度を算出した後、一部の成分についてはさらに共存ガス成分によるスペクトルの変化分の補正計算を行うようにしている。

【0 0 1 3】

前記補正計算を行う際、共存ガス成分が F T I R 法で測定可能ならばその測定結果を用いることができ、そのようにした場合、測定値の時間遅れが無視できる。また、共存ガス成分が F T I R 法で測定不可能ならば外部分析計より読み込んで使用すればよく、その場合、F T I R の C P U において時間合わせを行えばよい。

【0 0 1 4】

この発明の F T I R 法による多成分ガス分析方法によれば、通常定量アルゴリズムでは考慮できないスペクトル自体の強度変化に起因する誤差をも補正することができ、F T I R 法ガス分析の精度の向上が図れる。特に、排ガスと校正ガスのベースガス組成、特に、 $H_2O$  濃度の差、および、測定中のサンプルガスにおける  $H_2O$  濃度の変化による影響の補正に効果的である。

【0 0 1 5】

【発明の実施の形態】

この発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。上述のように、実サンプルガスを測定する場合、それに含まれる  $H_2O$  の影響が非常に大きい。そこで、以下に、F T I R 法で測定可能な成分である  $H_2O$  による CO 等への共存影

響を、多変量解析法による濃度演算後に補正する式の検討を行った例を説明する。なお、 $\text{H}_2\text{O}$ 以外の成分による影響は、事実上無視できることを前提にしている。

# 【0016】

## 1. 補正式の検討

### (1) 影響値の傾向確認

図2は、 $\text{CO}$  10%レンジに対する $\text{H}_2\text{O}$ の共存影響の例（リニアライズ前の値にて計算（Raw））を示し、同図（A）は $\text{CO}$ 濃度固定の場合を、同図（B）は $\text{H}_2\text{O}$ 濃度固定の場合をそれぞれ示している。この図2から、影響値の幅は、 $\text{H}_2\text{O}$ 濃度固定時の変化は、ほぼ一次式（ $Y = aX$ ）で近似できるが、成分によっては、二次式（ $Y = aX^2 + bX$ ）の方がよりよく近似できる例もあることがわかる。

# 【0017】

### (2) 影響のモデルと補正式

図3は、 $\text{CO}$ と $\text{H}_2\text{O}$ における影響値のモデルと補正式の例を示している。まず、このモデルは、 $\text{H}_2\text{O}$ のピーク強度（リニアライズ前の濃度計算値） $x$ （= $W$ ）と、 $\text{CO}$ のピーク強度の変化分（リニアライズ前の濃度計算値の変化分） $y$ とは、一次式（ $y = Sx$ ）の関係にあり、この一次式の傾き $S$ が、同図（A）に示すように、 $\text{CO}$ のピーク強度に応じて変化すると仮定する。前記傾き $S$ （= $Y$ ）と、 $\text{H}_2\text{O}$ の影響がない状態での $\text{CO}$ のピーク強度 $X$ （= $C$ ）との関係を、同図（B）に示すように、二次式（ $Y = aX^2 + bX$ ）で近似する。ここで、従来のPCR法で得られる $\text{CO}$ 濃度値 $R$ は、

$$\begin{aligned} R &= y + X \\ &= \{ (aX^2 + bX) \times x \} + X \end{aligned}$$

で表される。この式を $X$ （= $C$ ）について解くことにより、 $\text{H}_2\text{O}$ の影響を補正した $\text{CO}$ のピーク強度を求める関係式が導かれる。

# 【0018】

上記の方法において、補正係数 $a$ 、 $b$ を求めるには、前記図3（B）に示されるデータ、つまり、 $\text{H}_2\text{O}$ 濃度をほぼ固定して $\text{CO}$ 濃度のみを変化させたときの



共存影響の実測値を用いる ( $H_2O$  濃度を変化させたときのデータは不要)。

#### 【0019】

そして、補正後のCO濃度 (リニアライズ前)  $C$  は、次のように表される。

$a = 0$  ( $Y = bX$ ) のとき

$$C = R / (1 + bW)$$

$a \neq 0$  ( $Y = aX^2 + bX$ ) のとき

$$C = [\sqrt{\{(1 + bW)^2 + 4aWR\}} - (1 + bW)] / 2aW$$

ここで、 $R$  : 補正前のCO濃度 (リニアライズ前)

$W$  :  $H_2O$  濃度 (リニアライズ前)

#### 【0020】

### (3) 補正結果の例

図4は、図2に示した式で補正を行った例 (CO 10% レンジ) を示すもので、同図 (A) は補正前のデータを示し、同図 (B) は補正後のデータを示している。この補正方法により、最大で約 12% (フルスケール、FS) の影響値が ±1% 強の範囲に納まっていることがわかる。

#### 【0021】

### 2. 機差の確認

各装置ごとに係数決定のための実測データをどのように採取するかは、 $H_2O$  共存影響の絶対値・傾向のバラツキをもとに決定する必要がある。そこで、3台の装置A, B, Cを用いてこのバラツキと補正方法の簡略化の可能性について確認した。

#### 【0022】

### (1) 影響値の傾向確認

図5は、CO 10% レンジにおける影響値のバラツキを示すもので、同図 (A) は生データ (CO 10%) におけるCOのピーク強度と誤差との関係を示し、同図 (B) は規格化 (CO 10%) におけるCOのピーク強度と誤差との関係を示している。この図5から、絶対値としてはかなりの開きがあるものの、傾向には共通性があることがわかる。バラツキの一因として、PCR法の演算に用いるポイントが1台ごとに異なっていることが考えられる。

【 0 0 2 3 】

また、下記表 1 は他の成分をも含めた影響値のバラツキを示すもので、この表 1 から、影響が大きいのは、CO、CO<sub>2</sub>、NO、N<sub>2</sub>O であること、また、これらについては、バラツキ幅が大きいので、1 台ごとに補正係数を決める必要があることがわかる。

【 0 0 2 4 】

【表 1】

| 成分                                | レンジ     | 影響値 (FS%) |      |      | 平均<br>(FS%) | 最大偏差<br>(FS%) |
|-----------------------------------|---------|-----------|------|------|-------------|---------------|
|                                   |         | A         | B    | C    |             |               |
| CO                                | 200ppm  | 6.3       | 5.6  | 7.3  | 6.4         | 0.9           |
|                                   | 1000ppm | 8.5       | 7.3  | 9.5  | 8.4         | -1.1          |
|                                   | 5000ppm | 9.0       | 8.1  | 11.9 | 9.6         | 2.2           |
|                                   | 2%      | 9.9       | 8.0  | 13.7 | 10.5        | 3.2           |
|                                   | 10%     | 12.7      | 10.3 | 18.0 | 13.7        | 4.3           |
| CO <sub>2</sub>                   | 1%      | 10.3      | 11.0 | 8.0  | 9.8         | -1.8          |
|                                   | 5%      | 9.0       | 7.3  | 7.4  | 7.9         | 1.1           |
|                                   | 20%     | 11.7      | 11.9 | 3.6  | 9.0         | -5.5          |
| NO                                | 200ppm  | 3.7       | 3.1  | 5.0  | 3.9         | 1.1           |
|                                   | 1000ppm | 6.7       | 6.0  | 9.5  | 7.4         | 2.1           |
|                                   | 5000ppm | 8.7       | 9.0  | 11.4 | 9.7         | 1.7           |
| N <sub>2</sub> O                  | 200ppm  | 5.1       | 5.2  | 7.2  | 5.8         | 1.4           |
| NH <sub>3</sub>                   | 500ppm  | 5.1       | 3.4  | 2.3  | 3.6         | 1.5           |
| SO <sub>2</sub>                   | 200ppm  | -2.4      | 0.9  | -4.4 | -1.9        | 2.9           |
| CH <sub>3</sub> OH                | 500ppm  | 3.6       | 3.2  | 1.9  | 2.9         | -1.0          |
|                                   | 2000ppm | 2.4       | 1.5  | 0.7  | 1.5         | -0.9          |
| CH <sub>4</sub>                   | 500ppm  | 1.9       | 1.2  | 1.9  | 1.7         | -0.4          |
| C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>     | 500ppm  | 2.8       | 1.1  | -3.1 | 0.3         | -3.3          |
| C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>     | 200ppm  | -0.9      | 1.0  | -2.3 | -0.7        | 1.7           |
| 1,3-C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> | 200ppm  | 2.1       | 1.2  | -1.6 | 0.6         | -2.2          |
| iso-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> | 200ppm  | -0.4      | 1.5  | -3.5 | -0.8        | -2.7          |

【 0 0 2 5 】

(2) 補正の簡略化

前記表 1 に示した 3 台の装置 A～C の測定結果のうち、成分 CO、CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O について補正を行った結果を説明する。この場合、補正の方式としては次の 3

つがある。すなわち、

(a) 補正係数として二次式（前記図 3 における  $a \neq 0$ ）を用い、1 台ごとに決定する方式

(b) 補正係数として二次式（前記図 3 における  $a \neq 0$ ）を用い、3 台の装置 I, II, III のうち、ある装置の補正係数を基に傾きを決定する方式

(c) 補正係数として一次式（前記図 3 における  $a = 0$ ）を用い、1 台ごとに決定する方式

【0026】

以下、補正方法と結果を記す。

【0027】

(a) 1 台ごとに補正係数（二次式）決定した場合

すなわち、各成分 CO、CO<sub>2</sub>、NO について 5 点（1 / 5 分割点～5 / 5 分割点）ずつの Wet（N<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O ベース）スパンスペクトルを採取し、それに基づいて 1 台ごとに補正係数を決定した。結果は下記表 2 の通りである。

【0028】

【表 2】

| 成分              | レンジ     | 影響値（FS%） |      |      |
|-----------------|---------|----------|------|------|
|                 |         | A        | B    | C    |
| CO              | 200ppm  | 0.1      | -1.2 | 0.3  |
|                 | 1000ppm | 0.2      | 0.4  | 0.3  |
|                 | 5000ppm | 0.2      | 0.1  | 0.1  |
|                 | 2%      | 0.1      | -0.1 | 0.2  |
|                 | 10%     | 0.1      | 0.1  | 0.3  |
| CO <sub>2</sub> | 1%      | 0.1      | 0.2  | 0.3  |
|                 | 5%      | 0.1      | 0.2  | 0.2  |
|                 | 20%     | 0.1      | 0.1  | -0.2 |
| NO              | 200ppm  | 0.3      | -0.4 | 0.4  |
|                 | 1000ppm | -0.1     | 0.2  | 0.2  |
|                 | 5000ppm | 0.2      | 0.3  | 0.2  |

【0029】

(b) 同じ係数（二次式）で傾きのみ 1 台ごとに調整した場合

すなわち、前記表 2 で使用した各機のデータのうち、1 点（4 / 5 分割点）を

基に、A機用の補正係数（二次式）を修正して使用し、残りの4点の補正結果を評価した。結果は下記表3の通りである。なお、A機の結果は、前記表2における結果と同じである。

【0030】

【表3】

| 成分              | レンジ     | 影響値（FS%） |      |      |
|-----------------|---------|----------|------|------|
|                 |         | A        | B    | C    |
| CO              | 200ppm  | 0.1      | -2.4 | -0.8 |
|                 | 1000ppm | 0.2      | -1.2 | -0.5 |
|                 | 5000ppm | 0.2      | -0.2 | -0.3 |
|                 | 2%      | 0.1      | 0.3  | -0.6 |
|                 | 10%     | 0.1      | 0.2  | 0.9  |
| CO <sub>2</sub> | 1%      | 0.1      | -0.2 | -1.0 |
|                 | 5%      | 0.1      | -0.3 | -0.2 |
|                 | 20%     | 0.1      | 0.3  | -0.5 |
| NO              | 200ppm  | 0.3      | -0.6 | -1.0 |
|                 | 1000ppm | -0.1     | -0.3 | -0.5 |
|                 | 5000ppm | 0.2      | 1.0  | -0.4 |

【0031】

（c）一次式で1台ごとに補正した場合

すなわち、前記表2で使用した各機のデータのうち、1点（4／5分割点）のみを用いて補正係数（一次式）を決定し、残りの4点の補正結果を評価した。結果は下記表4の通りである。

【0032】

【表 4】

| 成分              | レンジ     | 影響値 (FS%) |      |      |
|-----------------|---------|-----------|------|------|
|                 |         | A         | B    | C    |
| CO              | 200ppm  | -0.6      | -1.9 | -0.8 |
|                 | 1000ppm | -0.5      | -1.6 | -1.0 |
|                 | 5000ppm | -0.4      | -0.4 | -0.6 |
|                 | 2%      | -0.6      | -0.4 | -1.2 |
|                 | 10%     | -0.7      | 0.5  | -1.4 |
| CO <sub>2</sub> | 1%      | 1.3       | -1.5 | -1.1 |
|                 | 5%      | 0.2       | -0.4 | -0.3 |
|                 | 20%     | 0.3       | -0.3 | -0.6 |
| NO              | 200ppm  | -0.6      | -0.8 | -0.9 |
|                 | 1000ppm | -0.6      | -0.8 | -0.7 |
|                 | 5000ppm | -0.6      | -0.6 | -0.8 |

【0033】

上記表2～表4から、一次式による(c)の場合でも、補正結果は±2%程度の幅に納まっており、各成分・レンジについて1点ずつの実測データ採取でも補正可能であることがわかる。

【0034】

【発明の効果】

以上説明したように、この発明においては、FTIR法で得られた吸収スペクトルに基づいて試料中の複数成分を定量分析するFTIR法による多成分ガス分析を行う場合、多変量解析法等によって混合ガススペクトルから多成分濃度を算出した後、一部の成分についてはさらに共存ガス成分によるスペクトルの変化分の補正計算を行うようにしているので、通常の変量解析アルゴリズムでは考慮できないスペクトル自体の強度変化に起因する誤差をも補正することができ、FTIR法ガス分析の精度の向上が図れる。

【0035】

特に、H<sub>2</sub>Oの例のように、FTIR法で得られた測定値で補正を行う際は、成分ごとの測定値が無視できるメリットがある。また、O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>など原理的にFTIR法で測定できない成分については、外部分析計から取り込んだ信号を、FTIRのCPUで時間合わせを行った上で補正に用いることにより、同様の効果を得ることができる。

【 0 0 3 6 】

この発明の多成分ガス分析方法は、排ガスと校正ガスの水分濃度の差、および、測定中のサンプルガスにおける  $H_2O$  濃度の変化による影響の補正に効果的であり、また、 $O_2$ 、 $H_2$  などによる影響も補正できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明方法を実施するための装置の一例を概略的に示す図である。

【図 2】

$CO$  10%レンジに対する  $H_2O$  の共存影響の例を示す図で、(A) は  $CO$  濃度固定の場合、(B) は  $H_2O$  濃度固定の場合を示している。

【図 3】

(A) は  $CO$  と  $H_2O$  における影響のモデルを表す図、(B) は補正式の一例を示す図である。

【図 4】

$CO$  濃度（計算値）と誤差との関係を示す図で、(A) は補正前、(B) は補正後を示している。

【図 5】

$CO$  10%レンジにおける影響値のバラツキを示し、(A) は生データを、(B) は規格化後をそれぞれ示している。

【図 6】

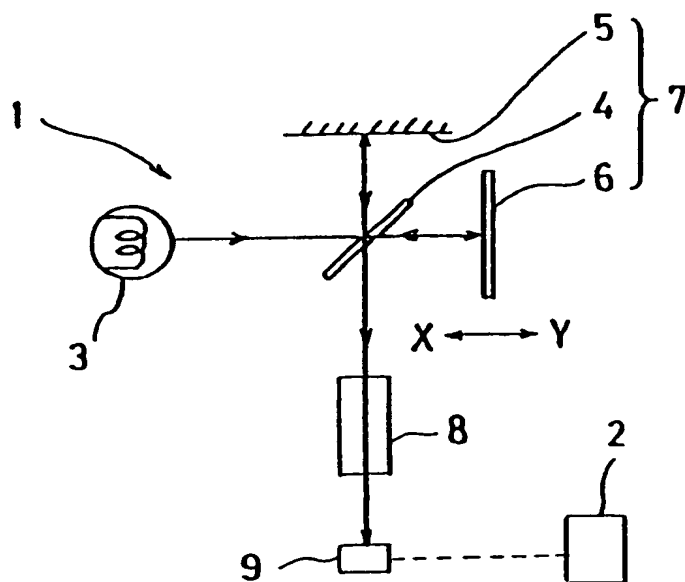
従来技術の問題点を説明するための図である。

【図 7】

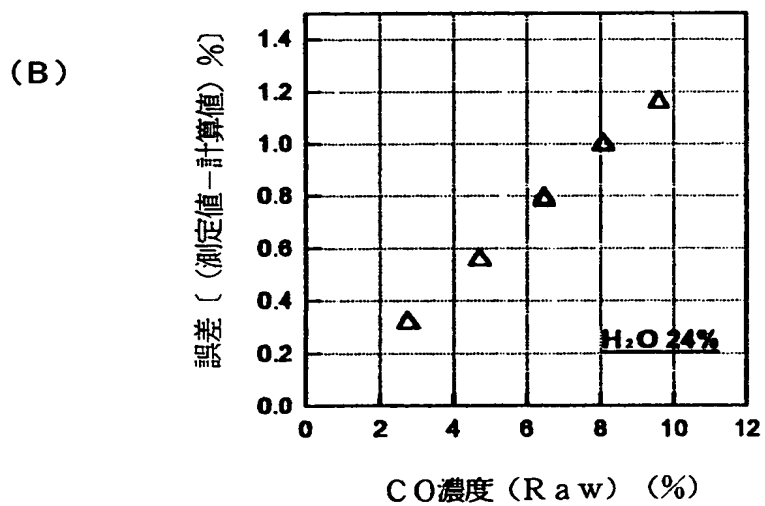
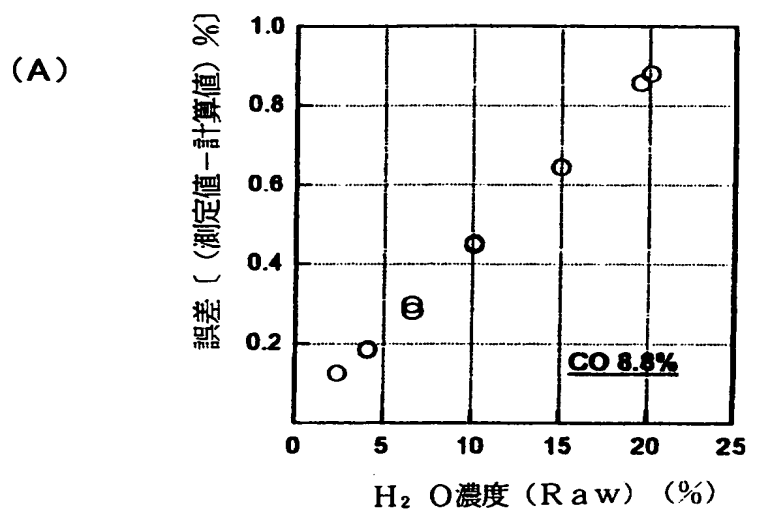
クエンチングによる赤外吸収量変化モデルを示す図である。

【書類名】 図面

【図 1】

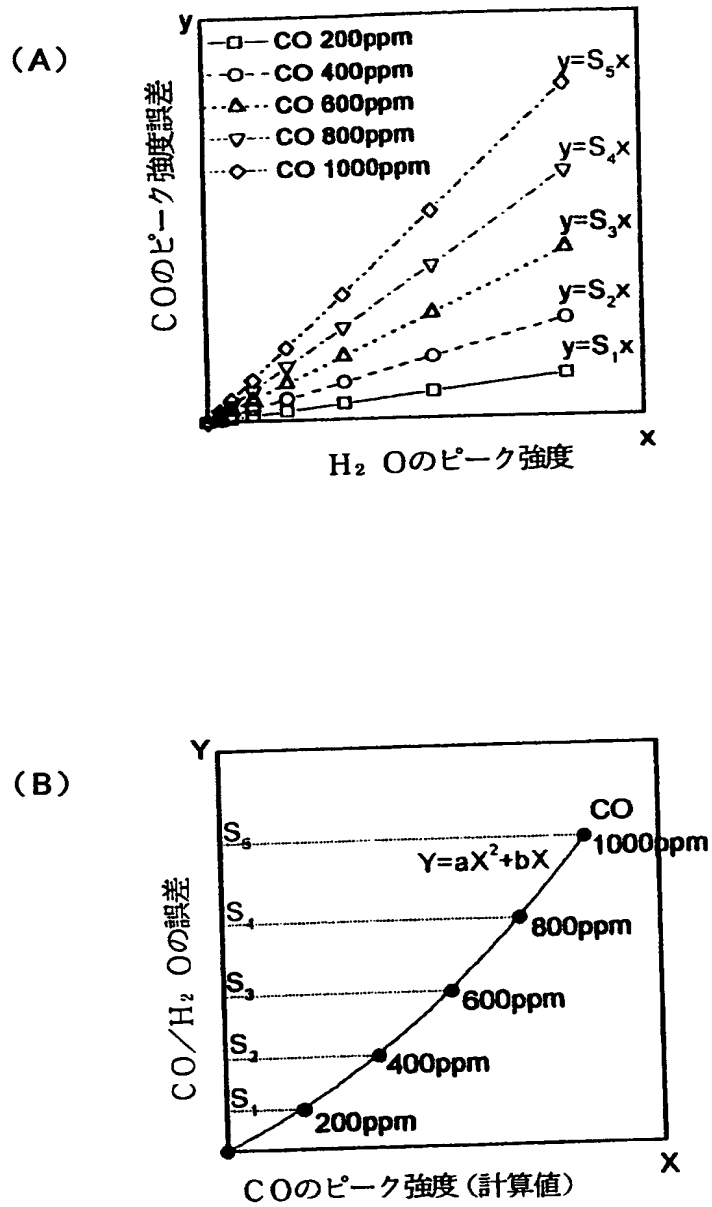


【図 2】

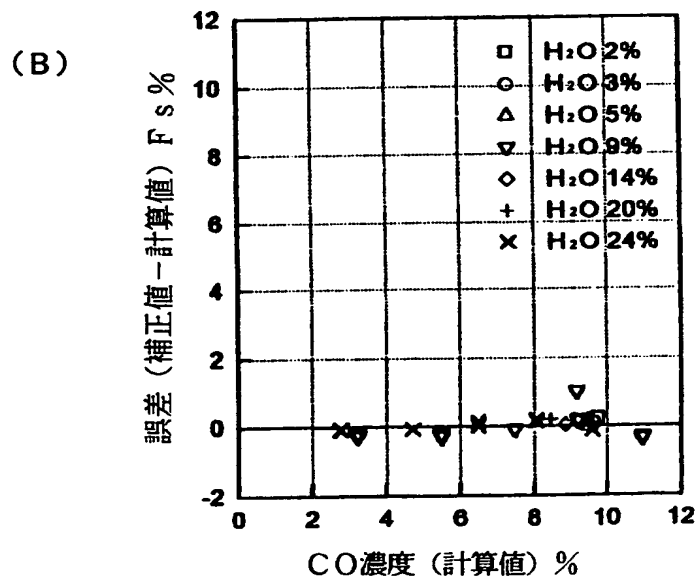
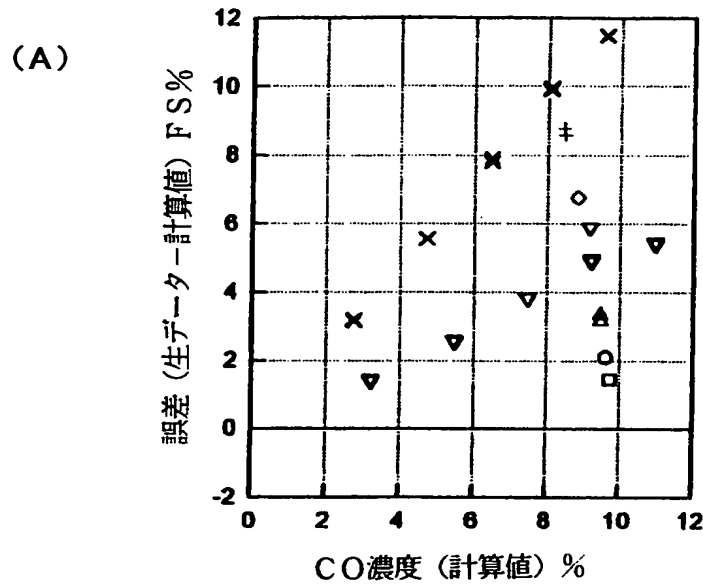




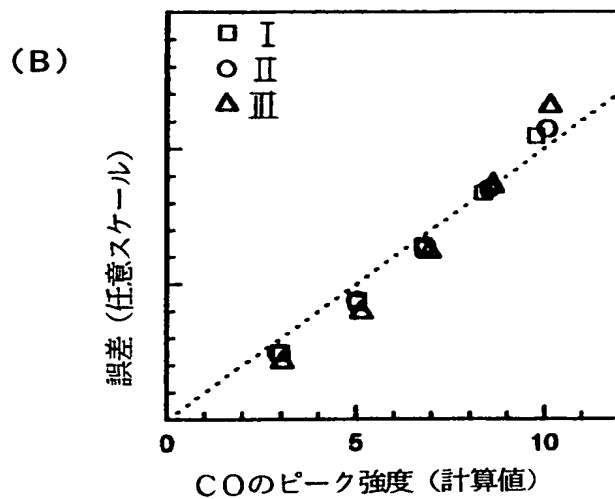
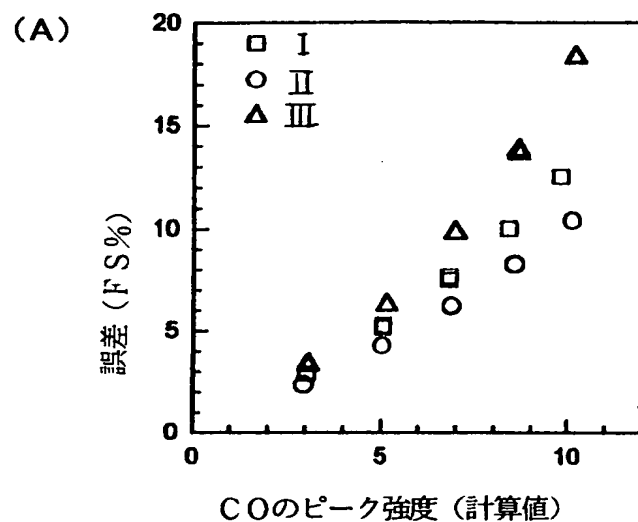
【図 3】



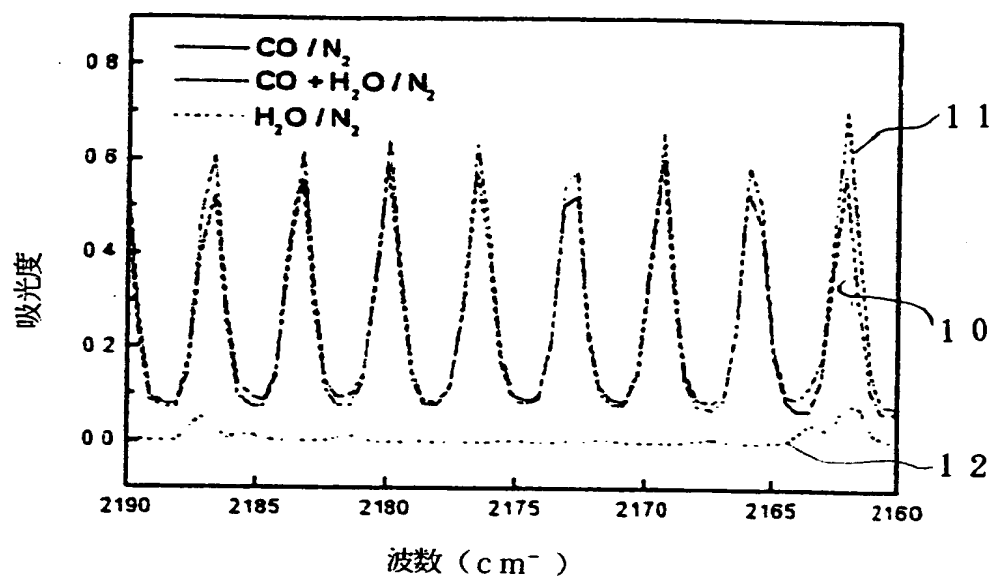
【図 4】



【図 5】

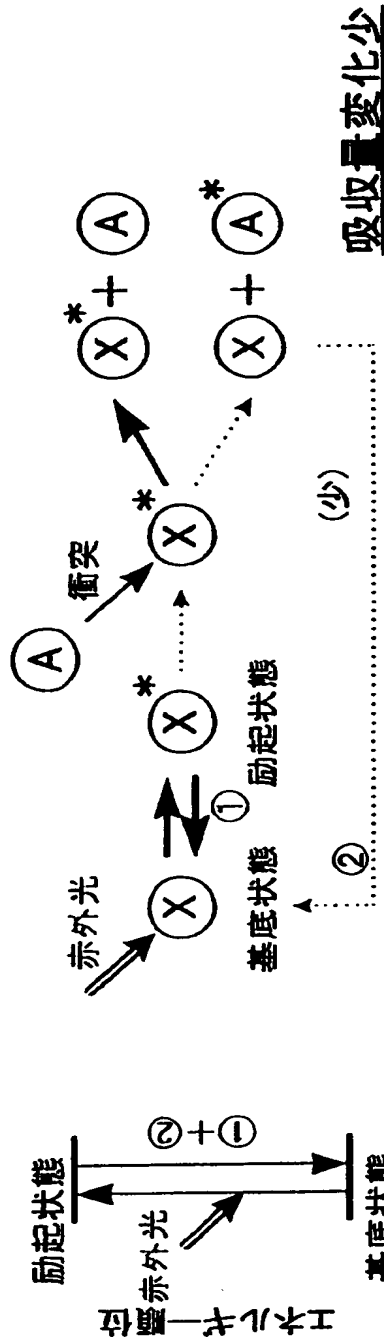


【図 6】

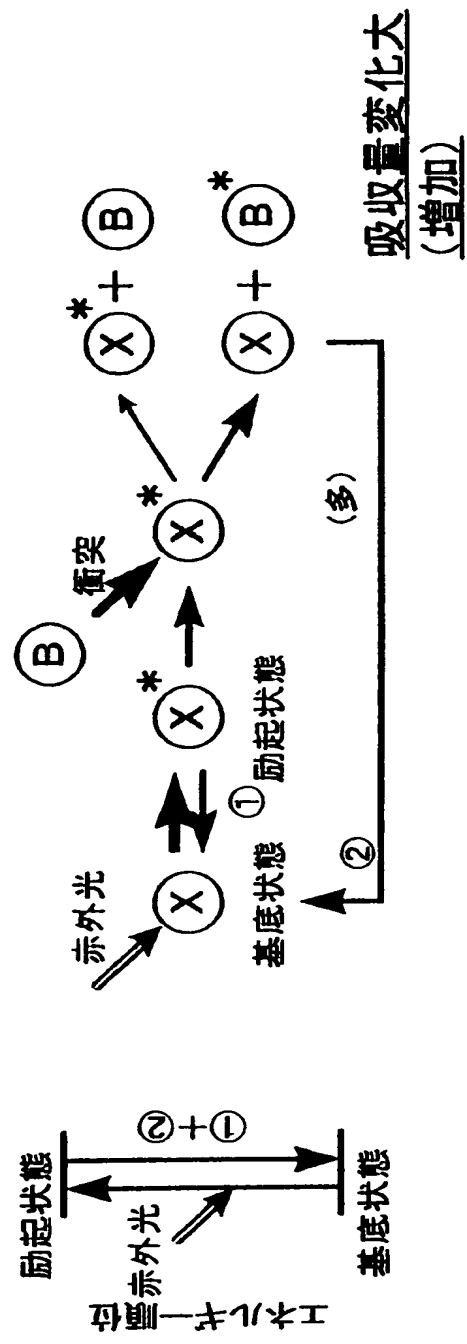


【図 7】

ベースガスA(衝突確率小、相互作用小)の場合



ベースガスB(衝突確率大、相互作用大)の場合



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ベースガス組成によるスペクトル自体の強度変化に起因する共存ガスの影響を補正し、精度の高い測定を行うことができる F T I R 法による多成分ガス分析方法を提供すること。

【解決手段】 F T I R 法で得られた吸収スペクトルに基づいて試料中の複数成分を定量分析する F T I R 法による多成分ガス分析方法において、定量アルゴリズムによって混合ガススペクトルから多成分濃度を算出した後、一部の成分についてはさらに共存ガス成分によるスペクトルの変化分の補正計算を行うようにした。

【選択図】 図 1

特平 1 1 - 1 5 8 4 9 3

## 認定・付加情報

|         |                       |         |                 |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|
| 特許出願の番号 | 平成 1 1 年              | 特許願     | 第 1 5 8 4 9 3 号 |
| 受付番号    | 5 9 9 0 0 5 3 2 7 6 6 |         |                 |
| 書類名     | 特許願                   |         |                 |
| 担当官     | 第三担当上席                | 0 0 9 2 |                 |
| 作成日     | 平成 1 1 年              | 6 月     | 8 日             |

### <認定情報・付加情報>

|       |             |
|-------|-------------|
| 【提出日】 | 平成11年 6月 4日 |
|-------|-------------|

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 1 5 5 0 2 3 ]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 9 月 3 日

[ 変更理由 ] 新規登録

住 所 京都府京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地

氏 名 株式会社堀場製作所